JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06314899 A

(43) Date of publication of application: 08.11.94

(51) Int. CI

H05K 13/04 G01R 31/26 H01L 21/66

H01L 23/32

(21) Application number: 05102347

(22) Date of filing: 28.04.93

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor.

OSHITA SHOICHI YAMAMOTO TAKASHI

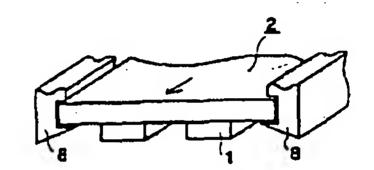
(54) APPARATUS AND METHOD FOR INSERTION AND EXTRACTION OF SEMICONDUCTOR

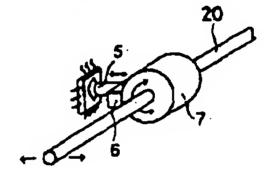
(57) Abstract:

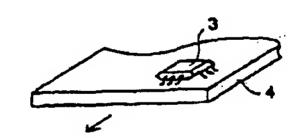
PURPOSE: To decrease a contact failure caused by a foreign body between an IC lead and an IC socket in an electrical characteristic test of an IC chip.

CONSTITUTION: A test board (2 or 14) is arranged in an IC insertion and extraction machine with its front surface down and a part for IC insertion of an IC socket is directed in vertical direction. Under this condition, an IC 3 is inserted into the IC socket. As inserted parts of the IC leads are directed in vertical direction, a foreign substance can be removed easily and also it is hard to stick.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO







(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-314899

(43)公開日 平成6年(1994)11月8日

(51) Int.Cl. ³ H 0 5 K G 0 1 R	13/04 31/26	識別記号 Z Z		FI	技術表示箇所
H01L	21/66 23/32	D	7630-4M		
	23/32	В			

審査請求 未請求 請求項の数8 〇L (全 6 頁)

		一—————————————————————————————————————	不明水 明水块0数6 OL (全 6 貝)	
(21)出顧番号	特願平5-102347	(71)出廢人	000006013	
(22)出顧日.	平成5年(1993)4月28日		三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号	
		(72)発明者	大下 昌一	
	·		兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機 株式会社北伊丹製作所内	
		(72)発明者	山本 隆司	
			兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機 株式会社北伊丹製作所内	
	•		弁理士 早瀬 憲一	
			•	

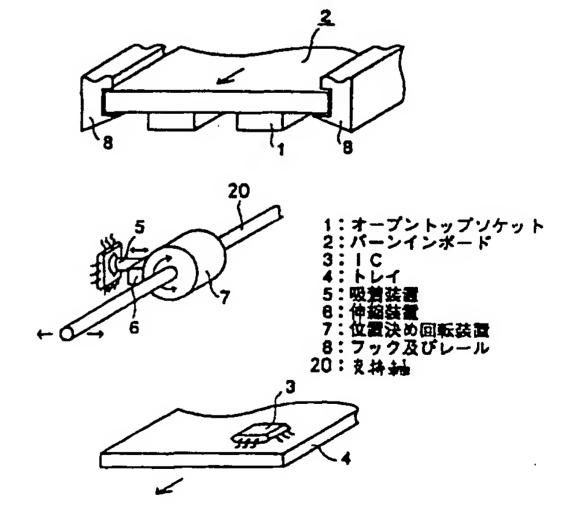
(54) 【発明の名称】 半導体挿抜装置及び半導体挿抜方法

(57)【要約】

【目的】 「Cチップの電気的特性試験において、「Cリードと「Cソケット間の異物によるコンタクト不良を低減させる。

【構成】 I C挿抜機内でテストポード (2または14)を下向きに配置して、I Cソケット1のI C挿入部分を鉛直方向に向け、この状態でI Cソケット1にI C3を挿入する。

【効果】 I Cリードの挿入部分が鉛直方向を向いているので異物が取れ易く、また付着しにくくなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 トレイ上に載置されて搬走されてきたI Cチップを移送し、テストヘッドに装着されたICソケットに挿入する、あるいはICソケットに挿入されたI Cチップを抜き取り、上記トレイ上に移送する半導体挿 抜装置において、

上記トレイと対向して配置され、上記ICチップのリード挿入孔が下向きに位置するように装着されたICソケットを有するテストポードと、

上記トレイと上記テストボードとの間で移動自在に配置 10 され、上記ICチップの移送及び上記ICソケットへの 挿抜を行う挿抜機構とを備えたことを特徴とする半導体 挿抜装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体挿抜装置において、

上記ICソケットに振動を加える振動発生機構を備えたことを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項3】 請求項1配載の半導体挿抜装置において、

上記半導体挿抜機構は上記ICソケットに空気を吹き付 20 けるためのエアー吹付機構を具備していることを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項4】 請求項1記載の半導体挿抜装置において、

上記テストポードと対向して配置され、上記ICソケットにICチップを挿入する前にそのリードの異物を除去するリードクリーニングポードを備えたことを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項5】 請求項4記載の半導体挿抜装置において、

上記リードクリーニングポードは、

その表面にヤスリを有し、該ヤスリに上記ICチップの リードを接触させることにより上記異物を除去するもの であることを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項6】 請求項4記載の半導体挿抜装置において、

上記リードクリーニングボードは、

該ポードに超音波振動を印加する振動発生器と、

上記ポード表面に設けられた洗浄用水槽とを有し、

上記洗浄用水槽に上記ICチップのリードを浸し、この 40 状態で超音波振動を印加することにより上記異物を除去 するものであることを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項7】 請求項5記載の半導体挿抜装置において、

上記リードクリーニングボードは、

上記ICチップのリードに空気を吹き付けるエアー吹付機構を備えていることを特徴とする半導体挿抜装置。

【請求項8】 トレイ上に載置されて搬走されてきた I 減のための対策を、容易にかて Cチップを、テストヘッド上に装着された I C ソケット とのできる半導体挿抜装置及で に挿入する、あるいは I C ソケットに挿入された I C チ 50 方法を得ることを目的とする。

ップを抜き取り、これを上記トレイ上に移送する半導体 挿抜方法において、

I Cチップのリード挿入孔が下向きに位置するよう I C ソケットをテストボードに装着し、

上記トレイ上に載置されたICチップを上記ソケットに 挿入することを特徴とする半導体挿抜方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はファイナルテスト工程 の 及びパーンイン工程において半導体(以下、IC)をテ ストポードに挿抜する装置及び該装置を用いた挿抜方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図9は従来の半導体挿抜装置を説明する ための側面提略図である。図において、1 (15) はデ バイスをブリント基板等に直接固定せずに、これを交換 可能とするためのICソケットと呼ばれる信号接続部 品、2はパーンインポード、14はパフォーマンスポー ドと呼ばれるテストポードであり、デバイスを試験する ための信号及び電源等が、試験対象となるデバイスの端 子と電気的に接続されるように中継するための基板であ り、上記 I Cソケット 1 を実装可能なように構成されて いる。上述のようにテストポードは、パーンイン工程で 用いられるパーンインポード2と、ファイナルテストエ 程で用いられるパフォーマンスポード14とに大別さ れ、前者の場合、ソケットはオープントップソケット1 を用い、後者の場合は通常のソケット15が用いられ る。3は試験対象となるデパイスであるIC、4はIC 3を搭載するためのトレイである。また5は10吸着装 30 置、6はIC吸着装置5を移動させるための伸縮装置で ある。

【0003】次に動作について説明する。IC挿入時には、トレイ4上のIC3を、伸縮装置6が伸びて吸着装置5に吸着させ、この状態でパーンインボード2(パフォーマンスポード14)に実装されたオープントップソケット1(通常のソケット15)上に運び、該ICソケット1にIC3を挿入する。IC3の抜取時には上記挿入時と逆プロセスとなる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の半導体挿抜装置 及び挿抜方法は以上のように構成されているため、テストポード上のICソケットとICのリードとの間に異物 が入り易く、コンタクト不良が発生するという問題点が あった。

【0005】この発明は、上記のような問題点を解消するためのもので、ファイナルテスト工程およびパーンイン工程におけるICとソケットとのコンタクト不良の低減のための対策を、容易にかつ省スペースで実現することのできる半導体挿抜装置及びこれに適した半導体挿抜方法を得ることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明に係る半導体挿抜装置は、トレイと対向する面にリード挿入孔が位置するようにICソケットが装着されたテストボードと、上記トレイと上記テストボードとの間で移動自在に配置され、上記ICチップの移送及び上記ICソケットへの挿抜を行う挿抜機構とを備えたものである。

【0007】また、上記ICソケットに振動を加える振動発生機構を備えたものである。

【0008】また、上記挿抜機構に上記ICソケットに 10 空気を吹き付けるためのエアー吹付機構を具備させたものである。

【0009】また、上記テストポードと対向して配置され、ヤスリ、洗浄用水槽、エア一吹付機構等を有し、I Cソケット挿入前のICチップのリードの異物を除去するリードクリーニングポードを備えたものである。

【0010】また、この発明に係る半導体挿抜方法は、 着を解除する。以上の動作 ICチップのリード挿入孔が下向きに位置するように I トレイ4に搭載されて運 Cソケットをテストポードに装着し、トレイ上に載置さ ット1に装着される。ない れたICチップを上記ソケットに挿入するようにしたも 20 入時と逆プロセスとなる。 のである。 【0016】このように

[0011]

【作用】この発明においては、トレイと対向する面にリード挿入孔が位置するようにICソケットをテストポードに装着し、ICチップを上記ICソケットへ挿入するようにしたから、ICチップ挿入時にICソケットのリード挿入孔が鉛直方向に向けられ、ICソケットに付着した異物が取れ易くなり、またICソケット内にも異物が入りにくくなる。

【0012】また、上記ICソケットに扱動を印加す 30 る、またはICソケットに空気を吹き付けることにより、ICソケットに付着した異物の除去を促進することができる。

【0013】また、「Cチップのリードをヤスリに接触させたり、洗浄水槽で洗浄したり、あるいは空気を吹き付けることにより、リードに付着した異物を除去することができる。

[0014]

【実施例】

実施例1.以下、本発明の第1の実施例による半導体挿技装置を図1に基づいて説明する。図において、図9と同一符号は同一または相当部分を示し、ここでは、テストポードをパーンインボード2として説明を行う。図において、8はパーンインボード2を保持、移動させるためのフック及びレールであり、また前記パーンインボード2の紙面下側にはオープンソケット1が実装されている。4は上記オープンソケット1に対向するように配置されたトレイであり、これにより複数個のIC3が搭載、移動される。また20は上記パーンインボード2とトレイ4との間の空間に移動自在に保持された支持軸で

あり、該支持軸20には伸縮装置6が位置決め回転装置6を介して取り付けられている。

【0015】次に動作について説明する。オープントッ プソケット1を取り付けたパーンインボード2をソケッ ト1が下向きになるようにフック及びレールに配置す る。一方、1C3を搭載したトレイ4は、上記パーンイ ンポード2と平行して矢印方向に挿抜装置中を移動す る。上記支持軸20及び位置決め回転装置7によって、 上記トレイ4上に搭載されて運ばれてきたIC3の上方 に伸縮装置6が位置するように該伸縮装置6が駆動制御 され、続いて伸縮装置6が伸びて吸着装置5がIC3に 近接し、エアーの吸引によりIC3がこれに吸着され る。IC3を吸着した後、伸縮装置6が一旦縮み、位置 決め回転装置 7 が支持軸 2 0 の回りを回動し、吸着した IC3をオープンソケット1に対向させ、続いて伸縮装 置6が伸びて吸着したIC3をソケット1に装着し、吸 着を解除する。以上の動作を繰り返して行うことにより トレイ4に搭載されて運ばれてきた1C3が次々にソケ ット1に装着される。なお、IC3の抜取時には上記挿

【0016】このように本実施例では、IC3を搭載したトレイ4上方にICソケット1を対向して配置し、吸着装置5、伸縮装置6、位置決め回転装置7を用いてトレイ4上のIC3を、上記ソケット1に対して下方から装着するようにしたから、ソケット1のIC挿入部分が下向きとなり、ソケット1に付着した異物が取れ易くなり、また異物がソケット1内に入りにくくなり、このためにIC3とソケット1とのコンタクト不良を低減することができる。

0 【0017】実施例2.次に本発明の第2の実施例による半導体挿抜装置を図2に基づいて説明する。図において、9はフック及びレール8に取付けられた振動装置である。

【0018】次に動作について説明する。上記振動装置 9を作動させて上記フック及びレール8に振動を与える ことにより、フック及びレール8に保持されたパーンイ ンポード2に振動が伝達され、これに実装されたソケッ ト1にも振動が加わり、ソケット1に付着した異物の除 去が促進される。

実施例1.以下、本発明の第1の実施例による半導体挿 40 【0019】このように本実施例によれば、フック及び 抜装置を図1に基づいて説明する。図において、図9と 同一符号は同一または相当部分を示し、ここでは、テス トポードをパーンインポード2として説明を行う。図に おいて、8はパーンインポード2を保持、移動させるた

【0020】実施例3.次に本発明の第3の実施例による半導体挿抜装置を図3に基づいて説明する。図において、10は、位置決め回転装置7に、伸縮装置6と対向する位置にて設けられたエアー吹付装置である。

載、移動される。また20は上記パーンインポード2と [0021]次に作用効果について説明する。IC30トレイ4との間の空間に移動自在に保持された支持軸で 50 挿抜方法については上記実施例1で説明した通りである

- -

が、本実施例ではトレイ4に搭載されたIC3を吸着装 置5で吸着した後、エアー吹付装置10によってソケッ ト1にエアーを吹き付ける工程が追加されている。この ため異物の除去を促進することができる。

【0022】実施例4.次に本発明の第4の実施例によ る半導体挿抜装置を図4及び図5に基づいて説明する。 図において、11は、吸着装置5に吸着されたIC3の リードに付着した異物を取り除くためのICリードクリ ーニング部である。このクリーニング部11の具体的な 構成としては、図5に示すように目の細かいヤスリ17 10 る効果がある。 が設けられている。

【0023】次に作用効果について説明する。図5に示 すように、IC3を吸着した吸着装置5をICクリーニ ング部11上方に移動させ、IC3のリード16を目の 細かいヤスリ17に接触させることにより、ICリード 16に付着した異物を取り除くことができる。

【0024】実施例5、次に本発明の第5の実施例によ る半導体挿抜装置を図6に基づいて説明する。上記実施 例4ではICクリーニング部11に目の細かいヤスリ1 7を設けてリード16に付着した異物を取り除くように 20 したが、本実施例ではICクリーニング部11に洗浄水 槽18を設け、かつ振動装置9によってICクリーニン グ部11に超音波振動を加えることにより、リード16 を洗浄するようにしたものである。

【0025】次に作用効果について説明する。【Cリー ドクリーニング部11において、IC3を吸着した吸着 装置5を1Cクリーニング部11上方に移動させ、1C リード16の先端を洗浄水槽18に浸し、振動装置9を 用いてクリーニング部11に超音波振動を加えることに より、ICリード16に付着した異物を取り除くことが 30 できる。

【0026】実施例6.次に本発明の第6の実施例によ る半導体挿抜装置を図7に基づいて説明する。図7に示 すように、本実施例ではICリードクリーニング部 1 1 にエアー吹付装置10を設けたものである。

[0027] 次に作用効果について説明する。 I C リー ドクリーニング部11において、IC3を吸着した吸着 装置5をICクリーニング部11上方に移動させ、IC リード16の先端をエアー吹付装置10に近接し、IC リード16にエアーを吹き付けることにより、ICリー 40 7 ド16に付着した異物を取り除くことができる。

【0028】なお、上記各実施例では、テストポードと してパーンインポード2を用いて説明したが、図8に示 すように、IC3のファイナルテスト工程に用いられる パフォーマンスポード14を用いる場合においても同様 の効果を奏する。なお13はパフォーマンスポード14 をテストヘッド12に取りつけるためのパフォーマンス ボード取付部である。

[0029]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、IC 50 17 ヤスリ

ソケットのICチップの挿入部分を下向に位置した状態 でICチップを挿入するようにしたから、ICソケット 内の異物が除去され易く、またICソケット内に異物が 入りにくいため、【Cチップのテストにおいて、コンタ クト不良を低減でき、また次の工程に異物が運び込まれ るのを防止できる効果がある。

【0030】また、上記ICソケットに振動を加える、 あるいは空気を吹き付けることで、上記異物の除去を促 進することができ、上記コンタクト不良をより低減でき

【0031】また、ICチップのリードをヤスリに接触 させる、洗浄用水槽に浸す、空気を吹き付ける等するこ とにより、リードに付着した異物を積極的に除去するこ とができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例による半導体(IC) 挿抜装置を示す斜視図である。

【図2】この発明の第2の実施例によるIC挿抜装置の 要部構成図である。

【図3】この発明の第3の実施例によるIC挿抜装置の 要部構成図である。

【図4】この発明の第4の実施例による【C挿抜装置の 要部構成図である。

【図5】上記実施例による【C挿抜装置のクリーニング 部の要部構成図である。

【図6】この発明の第5の実施例によるIC挿抜装置の クリーニング部の要部構成図である。

【図7】この発明の第6の実施例による【C挿抜装置の クリーニング部の要部構成図である。

【図8】この発明の第1の実施例による I C挿抜装置の 応用例を示す構成図である。

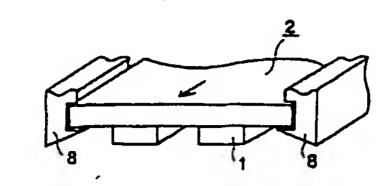
【図9】従来の【C挿抜装置を示す正面図である。

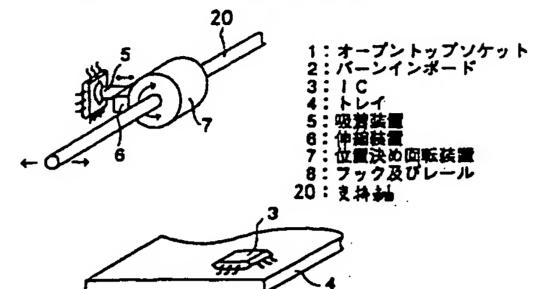
【符号の説明】

- オープントップソケット
- パーンインポード
- IC ·
- トレイ
- 吸着装置
- 伸縮装置
- 位置決回転装置
- フック及びレール
- 振動装置
- 10 エアー吹付装置
- 11 ICリードクリーニング部
- 12 テストヘッド
- 13 パフォーマンスポード取付部
- 14 パフォーマンスポード
- 15 ソケット
- 16 ICU-F

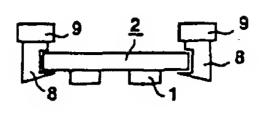
[図1]

7





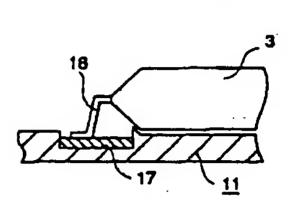
[図2]



9:接勤装置

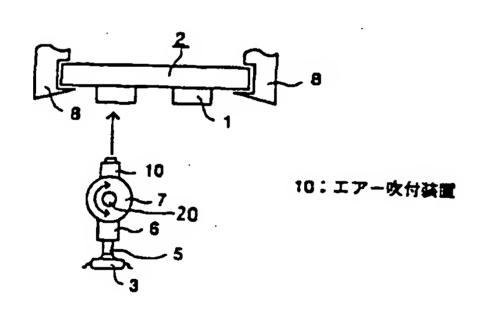
【図5】

8

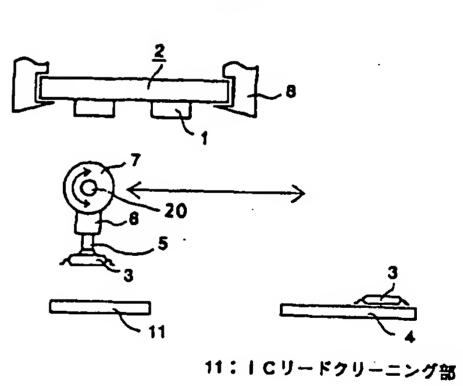


16: I Cリード 17: ヤスリ

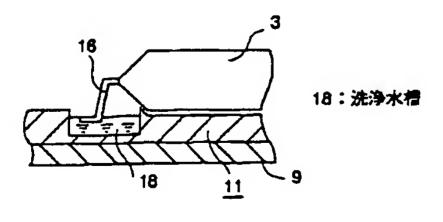
[図3]



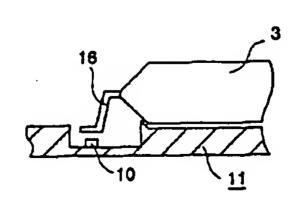
[図4]

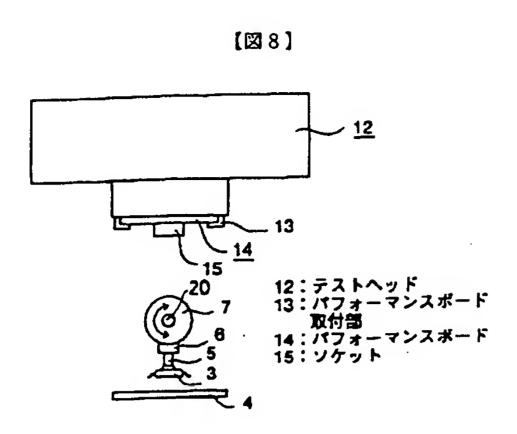


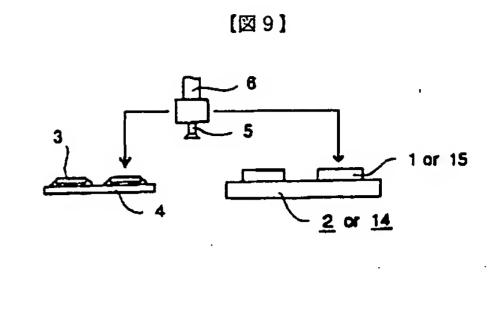
[図6]



[図7]







-:-